

## 第79回応用物理学会秋季学術講演会シンポジウム

### S20: ナノエレクトロニクス材料・デバイス研究開発を目指した 先端イオン顕微鏡技術

2018年9月20日(木) 13:30 ~ 18:00 233会場 名古屋国際会議場

イオン顕微鏡技術への認識を深め、今後の材料、デバイスの研究開発での有効活用を促し、イオン顕微鏡技術、および材料・デバイス技術の研究開発を加速することを目的として、近年のガスおよび金属Gaイオン顕微鏡など先端イオン顕微鏡技術を用いたいくつかの研究成果を広く議論します。

英語での発表ですが、質疑は日本語大歓迎です。

世話人: 小川真一(産総研)、米谷玲皇(東大)

#### 講演の一部

1. Imaging, Modification, and Analysis of Nanostructures with the Helium Ion Microscope  
Armin Götzhäuser (Bielefeld University)
2. Graphene nanoelectromechanical (GNEM) devices functionalized by using helium ion beam for nanoscale thermal engineering  
Hiroshi Mizuta, et al. (JAIST, AIST)
3. Carrier transport analysis of graphene with crystalline defects generated by helium ion beam irradiation  
Shu Nakaharai, et al. (NIMS, AIST)
4. Nano Patterning and Observation Using Helium Ion Microscope, Usage Examples at Osaka University  
Kimihiro Norizawa (ISIR, Osaka Univ.)
5. Energy Analysis of H<sup>3+</sup> Ion Beam Emitted from Gas field ionization source  
Shinichi Matsubara, et al. (Hitachi, Ltd., Hitachi High-Tech Science Co.)
6. NanoSIMS in Orion NanoFab  
Vignesh Viswanathan, et al. (Carl Zeiss Microscopy GmbH)
7. Xenon Plasma FIB Technology and Applications  
Kaoru Murata, et al. (Thermo Fisher Scientific)

